

LONGLITE® DRY FILM PHOTO RESIST

FF-9050S

LONGLITE® Dry Film Photo Resist FF-9050S 为负型、水溶性干膜光阻，具有良好的解像力与密着力，适用于细线路酸性蚀刻、Whqwlqj、电镀铜等印刷电路板不同制程。

特性：

- 41 具有优异的解像力。
- 51 具有优异的附着力及覆盖力。
- 61 具有优良的耐化学药品性与耐电镀特性。
- 71 膜性柔韧，Whqwlqj 特性优异。
- 81 对电镀液污染性极低。
- 91 曝光后颜色对比明显。

规格：

W sh#	IIO<383V#
Uhlvw厚度#	7:±5μp
标准宽度级距	31458#qfk#
长度	833m#trot#

储存：

建议水平放置于干燥之冷藏库内，储存环境条件：温度 8~53°C（温度低于 45°C 使用前要进行回温动作）、相对湿度 83±43%，干膜品质保存期限 9 个月，流胶保证期限为 3 个月。

使用安全守则：

- 41 在 XY Oihh 之黄色光源下使用，不使用时应以不透光布覆盖，并水平存放。
- 51 压膜时会产生气味，应注意压膜室之排气。
- 61 皮肤接触到光阻剂层可能会有刺激感，应避免直接碰触。使用后应以肥皂洗手，如果刺激感持续，应就医检查。

◆ ORQJOIWH® 为长春公司之注册商标。

◆ ORQJOIWH® Gull#lop #skrw#Uhlvw 为长春公司与东京应化工业株式会社 wrn|r#knd|N rj|r#Fr140vg1 技术合作生产。

本资料所列数据为本公司依照实验所得结果而记载，并不作为质量保证之依据。

试验项目：

- 41 显像时间、Exposure time##
- 51 不同曝光能量下之再现性#0#感度、解像性线距,、密着性线宽,、干膜线路宽度变化
- 61 剥膜特性
- 71 发色浓度
- 81 Whowling 特性

Whowling:

- 41 基板： # 41#pp# 2#铜厚度 68μm ,#
- 51 前处理： Relyon#Exihulogj#srak#6P #653#→#833 ,#
- 61 预热： # Etek#sh#tyhq#3°C #43# lq##(压膜前基板表面温度约 83°C ,
- 71 压膜：
 - 滚轮温度： 433°C
 - 滚轮压力： 7B#nj2#p⁵
 - 速度： 5B#p lq#
- 81 Krug#p h: 压膜后 48#lq
- 91 曝光： UVE-M500 型 5KW 超高壓水銀燈
- :1 Krug#p h: 曝光后 48#lq#
- ;1 显像：
 - 显像液： 4 (#QdFR₆#t#
 - 温度： 5<±4°C
 - 喷压： 42~1.4#nj2#p⁵
 - ES： 83 (
- <1 剥膜：
 - 剥膜液： 5B (、 6B (、 7B (#QdRK##
 - 温度： 83°C 、 88°C 、 90°C
 - 喷压： 浸泡式

41 显像时间、Exposure Time

Euhdn#Srlgw#	65vhf#
显像时间#IS1,#	97vhf

51 不同曝光能量下之再现性:

项目	感度	解像性线距,	密着性线宽,	干膜线宽度变化
单位	+Vwls,#	+μp,#	+μp,#	+μp,#
曝光量 +P M2E P ⁵ ,	45#	7#	93#	;3#
	48#	8#	93#	06#
	55#	9#	83#	-1
	63#	:#	93#	1
	78#	;#	93#	3
	93#	<#	;3#	5
	;3#	43#	433#	:#

备注:

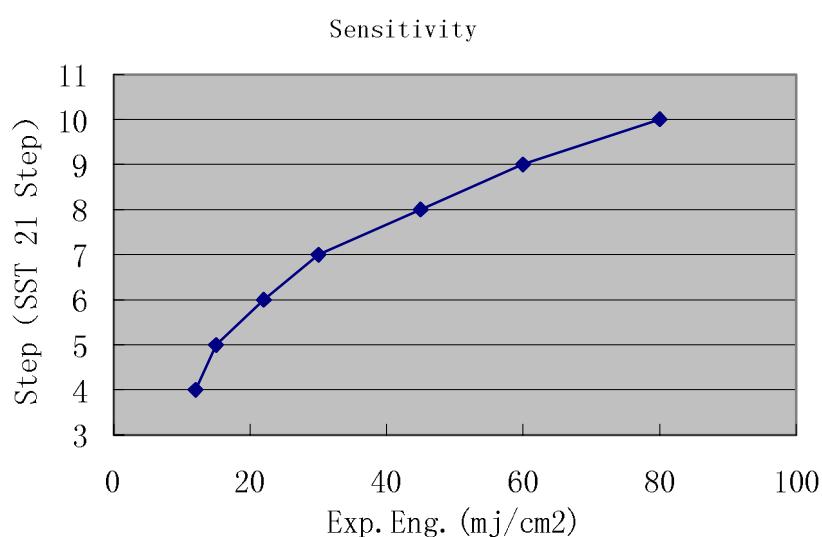
d1 Gdwhru#hihjhqfh#

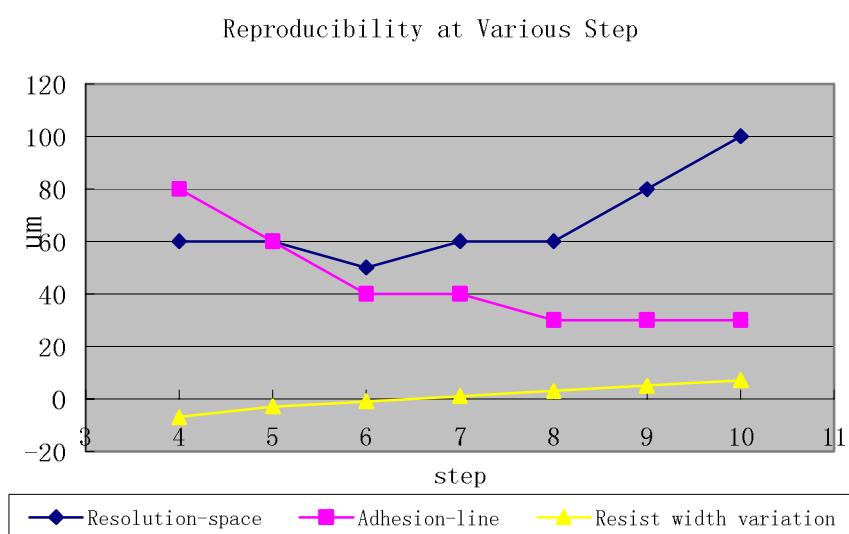
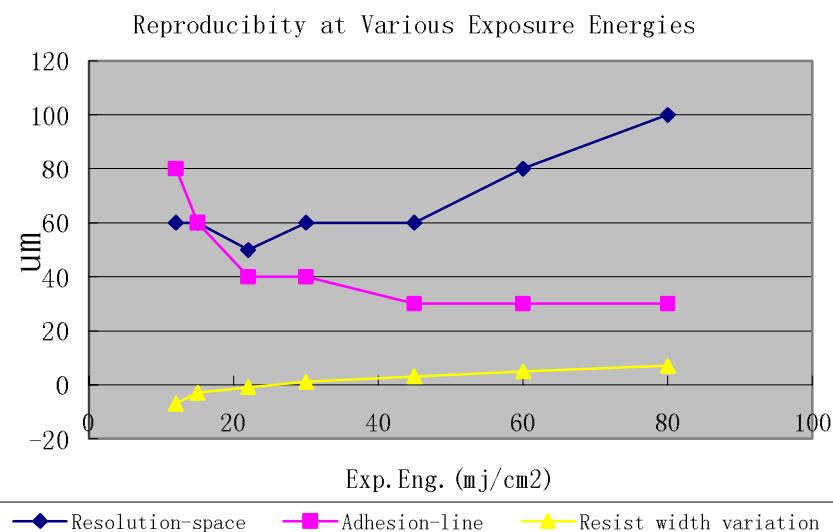
e1 感度: Vwxiihu#54#段曝格表Vwxiihu#54#whsv#hgvlylw#xlg, 直接放置于干膜上, 曝光、显像后记录残留之 wls。

f1 解像性: 测试底片 FFS#Sdwhuq05#02V@421,, O字型线路, 43E<3μp。

g1 密着性: 测试底片 FFS#Sdwhuq05#02V@427,, O字型线路, 43E<3μp。

h1 干膜线路宽度变化: 计算显像后干膜线宽与测试底片线宽之差异, 测试底片: 02V#<32693μp。





61 剥膜特性

剥膜液浓度 / 剥膜液温度	83°C #		88°C		60°C	
	剥离时间 +hf,	剥离片形 状	剥离时间 +hf,	剥离片形 状	剥离时间 +hf,	剥离片形 状
5 (#)	9<0:6#	片状有裂 口	8;099	片状有裂 口	84096	片状有裂 口
6 (#)	4707<	片状有裂 口	41077	片状有裂 口	73075	片状有裂 口
7 (#)	6;073#	片状有裂 口	6906;	片状有裂 口	67069	片状有裂 口

71 发色浓度

曝光前	3147
曝光后+:#Vhs,#	316:

81 Whqlqj 特性

强度+j,	7681:
时间+hf,	7165

备注：

d1 G d#iru#hihugfh#
e1 曝光量: :#Vhs#
f1 J dxjh: φ5p p 1#
g1 Vshhg: 43p p 2p lq#
h1 Erdug: φ9p p 4klnqhv#19p p 1#

建议操作条件：

● 表面处理:

w | sh: 化学微蚀或研磨
水破试验：至少 48±63#hf#直立，
▶ 板面仍有水时，勿以热风直接吹干。
▶ 建议表面粗糙度：U_d@3.5±3.7 μp , U_j@4.8±5.18 μp 。

● 压膜:

贴膜温度: # 88±98°C	滚轮温度: 443±43°C
贴膜压力: 5±8#hj2#p ⁵	滚轮压力: 6±8#hj2#p ⁵
贴膜时间: 418±5#hf#	速度: 43±6.3#p 2p lq#
入板温度: # 73±93°C	
出板温度: # 78±88°C	
Kraglqj#hp h①: 48#p lq±57#ku#56±5°C / 3±43 (#JK ,#	
▶ 入板温度如果超过 :3°C，盖于镀通孔上之干膜有可能变较薄。 ▶ 调整滚轮温度及压力时请依照压膜机使用手册之指示。 ▶ 压膜后基板应直立放置冷却至室温。 ▶ 压膜后之基板如果会在黄色 XY oihh 光源放置超过 9#u, 务必以不透光布遮盖基板。	

● 曝光:

Vhs: 9±<#Vhs#VVW#54#Vhs,
Kraglqj#hp h②: # 48#p lq±57#ku#56±5°C / 3±43 (#JK ,##
▶ Kraglqj#hp h①与 Kraglqj#hp h②合计应小于 5 天。

● **显像:**

显像液: 31:1# w(#Q d₅FR₆

温度: # 59±63°C

喷压: ## 45~51#n_j2_p⁵

显像点: 42±5%

► 建议水洗温度 48±8°C, 水洗喷压 45±1#n_j2_p⁵。

► 调节水洗槽流量以控制第一水洗槽能维持 SK# 以下。

► 干膜负荷量: 小于 43j_D。

● **蚀刻:**

w | sh: 氯化铜或氯化铁酸性蚀刻液

● **剥膜:**

脱膜液: 618±31# w(#Q dR K #uNR K #

温度: # 80~55°C

喷压: 418±61#n_j2_p⁵

剥膜点: 42±5%

► 干膜负荷量小于 53j_D。

► 建议水洗喷压大于 43n_j2_p⁵。